02

## Определение тока насыщения электролюминесценции светодиодов с набором квантовых ям

© М.А. Минтаиров, В.В. Евстропов, Н.А. Калюжный, Д.А. Малевский, С.А. Минтаиров, М.З. Шварц

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия e-mail: mamint@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 03.05.2024 г. В окончательной редакции 27.07.2024 г. Принята к публикации 30.10.2024 г.

Исследованы экспериментальные спектры электролюминесценции для светодиода (площадь  $1 \text{ mm}^2$ ) на основе Al<sub>0.2</sub>Ga<sub>0.8</sub>As *p-i-n*-перехода с шестью квантовыми ямами In<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>As шириной 3 nm и получена экспериментальная зависимость интенсивности основного пика электролюминесценции от плотности тока. При малых плотностях эта зависимость линейна (пропорциональна) и сублинейна при больших. Для исследуемого образца расчет показал, что плотность тока, при которой начинается насыщение  $J_{sat} \sim 30 \text{ A/cm}^2$ . Предложен экспериментальный метод, позволяющий определить  $J_{sat}$ . Экспериментальное значение для светодиода с шестью квантовыми ямами составило 210 A/cm<sup>2</sup>, что в пересчете на одну яму дает 35 A/cm<sup>2</sup>.

Ключевые слова: светодиоды, насыщение интенсивности электролюминесценции.

DOI: 10.61011/OS.2024.12.59794.6601-24

Полупроводники III–V широко используются в качестве материалов для изготовления светодиодов различного практического применения [1]. При этом для формирования активной области светодиодов часто используются квантовые ямы (КЯ), что улучшает их внутреннюю квантовую эффективность [2]. Известно, что в таких структурах может возникать проблема полного заполнения квантовой ямы, в результате чего зависимость интенсивности люминесценции от тока, пропускаемого через светодиод, стремится к насыщению [3–9]. В работах [3–5] область насыщения отчетливо регистрировалась, а в работах [6–9] обнаружено отклонение характеристики от линейного вида и начало тенденции к насыщению.

Явление насыщения ограничивает применение светодиодов там, где требуется линейность связи между интенсивностью электролюминесценции и током через светодиод. Поэтому определение закономерностей явления насыщения имеет практическую значимость. В работе анализируется линейный участок (отсутствует насыщение), сублинейность (тенденция к насыщению) и граница между участками, т.е. плотность тока  $J_{sat}$ , при которой начинается насыщение. Для экспериментального определения  $J_{sat}$  предложен метод, в основу которого положена эмпирическая формула, описывающая характеристику "интенсивность люминесценции — плотность тока".

Рассмотрим характеристику L-J ("интенсивность электролюминесценции-сила тока"), она содержит два участка: линейный и сублинейный. Участки соответствуют слабой и сильной инжекции. Энергетические диаграммы представлены на рис. 1. Ток через *p-n*-переход, пока нет насыщения, обусловлен бимолекулярной рекомбинацией в КЯ (как, к примеру, показано в работах [10–12]):

$$I = q(B^{2D} + B_{nr}^{2D})n^{2D}p^{2D},$$
(1)

где  $B^{2D}$  и  $B_{nr}^{2D}$  — соответственно излучательный и безызлучательный коэффициенты бимолекулярной рекомбинации,  $n^{2D}$  и  $p^{2D}$  — концентрации двумерных (2D) электронов и дырок выражаются через квазиуровни Ферми. Интенсивность бимолекулярной люминесценции определяется выражением

$$L = B^{2D} n^{2D} p^{2D}.$$
 (2)

Из сравнения (1) и (2) следует, что интенсивность люминесценции (плотность потока фотонов  $\left(\frac{\text{photon}}{\text{s-cm}^2}\right)$  пропорциональна силе тока, пока нет насыщения (в том числе при слабой инжекции).

Рассмотрим случай сильной инжекции [1]. При сильной инжекции (в противоположность слабой) электронный квазиуровень Ферми расположен выше уровня квантования в электронной яме:  $F_n^{2D} > E_n$ , а для дырок, наоборот,  $F_p^{2D} < E_p$  (рис. 1, *b*). При сильной инжекции концентрации электронов и дырок выражаются через квазиуровни Ферми

$$n^{2D} = N_C^{2D} \frac{F_n^{2D} - E_n}{kT}, \quad p^{2D} = N_V^{2D} \frac{E_p - F_p^{2D}}{kT},$$

где  $N_C^{2D}$ ,  $N_V^{2D}$  — плотность электронных и дырочных состояний в квантовой яме, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. В предельном случае (концентрация электронов стремится к плотности электронных состояний)  $F_n^{2D} \to E_C$ . Следовательно,



**Рис. 1.** Общий вид энергетической диаграммы квантовой ямы при двух уровнях инжекции: a — слабая, b — сильная. Отметим, что в расчете величины  $J_{sat}$  для исследуемого образца использованы следующие значения величин:  $E_g = 1.6734 \text{ eV}$ ;  $E_n - E_p = 1.541 \text{ eV}$ .

$$F_n^{2D} - E_n 
ightarrow \Delta E_n, \, n^{2D} 
ightarrow n_{sat}^{2D},$$
где

$$n_{sat}^{2D} = N_C^{2D} \frac{\Delta E_n}{kT},\tag{3a}$$

аналогично

$$p_{sat}^{2D} = N_V^{2D} \frac{\Delta E_p}{kT},\tag{3b}$$

где

$$N_C^{2D} = m_C \frac{m_0 kT}{\pi \hbar^2}, \quad N_V^{2D} = m_V \frac{m_0 kT}{\pi \hbar^2},$$
 (4)

где  $m_0$  — масса электрона в вакууме,  $\hbar$  — постоянная Планка,  $m_C$ ,  $m_V$  — безразмерные массы электрона и дырки соответственно. В случае сильной инжекции следует учитывать условие нейтральности  $n^{2D} = p^{2D}$ . Насыщение интенсивности люминесценции наступает, когда полностью заполняется либо только электронная яма, либо только дырочная. Тогда в уравнении для тока (1) произведение концентраций  $n^{2D}p^{2D}$  равно наименьшему из двух значений:  $(n_{sat}^{2D})^2$ ,  $(p_{sat}^{2D})^2$ , где  $n_{sat}^{2D}$  и  $p_{sat}^{2D}$  — концентрации, при которых наступает полное заполнение электронной или дырочной ям соответственно. Плотность тока, при которой наступает насыщение

люминесценции,

$$J_{sat} = q(B^{2D} + B_{nr}^{2D}) \times \begin{cases} (n_{sat}^{2D})^2, & \text{если } n_{sat}^{2D} < p_{sat}^{2D} \\ (p_{sat}^{2D})^2, & \text{если } n_{sat}^{2D} > p_{sat}^{2D} \end{cases}$$
(5)

или с учетом выражений (3), (4)

$$J_{sat} = q(B^{2D} + B_{nr}^{2D}) \left(\frac{m_0}{\pi\hbar^2}\right)^2 \times \begin{cases} (m_C \Delta E_n)^2, & \text{если} \quad n_{sat}^{2D} < p_{sat}^{2D} \\ (m_V E_p)^2, & \text{если} \quad n_{sat}^{2D} > p_{sat}^{2D}. \end{cases}$$
(6)

Рассмотрим применение полученных выражений к экспериментальным структурам. Светоизлучающие *р-і-п-*структуры создавались методом ΜΟΓΦЭ (металл-органической газофазной эпитаксии). Матрица Al<sub>0.2</sub>Ga<sub>0.8</sub>As  $(E_g = 1.6734 \,\mathrm{eV})$  состоит из трех областей: р-типа, электрически нейтральной и *п*-типа. Эта *p*-*i*-*n*-структура ограничена с обеих сторон широкозонными барьерами. В нелегированной области расположены КЯ In0.1Ga0.9As шириной 3 nm. Площадь изготовленного светоизлучающего диода на основе *p-i-n*-структуры составляла 1 mm<sup>2</sup>.



**Рис. 2.** Спектры электролюминесценции КЯ при разных токах. Кружки — экспериментальные данные, сплошные линии того же цвета — аппроксимация при помощи суммы трех полос гауссовой формы. Штриховыми линиями показан результат разложения спектра на три полосы: красный цвет — при минимальном измеренном токе, черным — при максимальном. Значения токов те же, что на рис. 3.

Для изготовленной структуры было проведено измерение спектров электролюминесценции в диапазоне плотностей токов от 0.2 до 500 A/cm<sup>2</sup>. Управляющий сигнал заданной амплитуды с выхода цифро-аналогового преобразователя системы сбора данных подавался на силовой операционный усилитель, на выходе которого формировался прикладываемый к испытуемому образцу импульс постоянного тока и напряжения. Для предотвращения нагрева исследуемого образца использовался режим серии последовательных импульсов тока длительностью 150 µs и периодом 20 ms. Для проверки стабильности температуры в течение единичного импульса оценивалось постоянство прикладываемого напряжения при протекании фиксированного тока. Для соответствия динамическому диапазону чувствительности спектрометра количество импульсов уменьшалось при усилении тока через образец, уровень электролюминесценции при этом приведен к единичному импульсу.

Полученные спектры электролюминесценции (рис. 2) были разложены на полосы гауссовой формы и включали в себя по крайней мере две полосы с пиками на 1.48 и 1.54 eV. Эти полосы соответствуют излучательным переходам на уровни тяжелых и легких дырок соответственно. Была детально исследована основная полоса (переход электрон-тяжелая дырка). Зависимость интегральной интенсивности этой полосы от плотности тока (рис. 3) имеет два участка: линейный и насыщающийся. Зависимость аппроксимирована эмпирической экспоненциальной функцией:

$$L = pJ_{sat}\left(1 - \exp\left(\frac{-J}{fJ_{sat}}\right)\right),\tag{7}$$

где f — число КЯ в нелегированной области (для исследуемого образца f = 6), p — коэффициент пропорциональности между интенсивностью электролюминесценции и плотностью тока. Коэффициент p определялся напрямую из экспериментальной L-J-зависимости, на которой выделялся участок, где  $L \propto J$ . Для полученной экспериментальной зависимости (рис. 3) этот участок находился между 5 и 30 А/сm<sup>2</sup>, а величина  $p = 1.762 \text{ сm}^2/\text{А}$ . Таким образом, выражение (7) содержит один параметр подбора — искомую плотность тока  $J_{sat}$ . Результат аппроксимации выражением (7) приведен на рис. 3,  $J_{sat} = 35 \text{ А/сm}^2$ .

Величина  $J_{sat}$  была также оценена расчетно. Расчет производился поэтапно по формулам (3), (4) и первому варианту формулы (5), где тепловая энергия  $kT \sim 0.025 \,\text{eV}$ , глубина уровней оценивалась по формуле  $\Delta E_n \sim \Delta E_p = (E_g - h\nu)/2$ , где  $E_g = 1.6734 \,\text{eV}$ ,



**Рис. 3.** Зависимость интегральной интенсивности основной полосы (1.48 eV) от плотности тока: кружки — эксперимент, сплошная линия — результат аппроксимации по формуле (7), штриховые линии — асимптоты для линейного и насыщающегося участков. Размерности осей на вставке те же, что и на основном рисунке.

 $hv = E_n - E_p = 1.541 \,\mathrm{eV}$  (hv — энергия фотонов, определенная по положению соответствующего максимума на рис. 2). Плотность состояний определялась по формуле (4), где  $m_C = 0.027, m_V = 0.42,$  $N_C^{2D} = 2.84 \cdot 10^{11} \,\mathrm{cm}^{-2};$   $N_C^{2D} < N_V^{2D} = 4.40 \cdot 10^{12} \,\mathrm{cm}^{-2}.$ Рассчитанная по (3а) концентрация электронов составляла  $n_{sat}^{2D} = 7.49 \cdot 10^{11} \,\mathrm{cm}^{-2}$ . Бимолекулярный  $B^{2D} = B/d$ , согласно [1], коэффициент, где  $B = 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s}$  — 3*D*-коэффициент, d = 3 nm ширина КЯ, безызлучательный коэффициент  $B^{2D}_{nr}$ не Используя приведенные учитывался. выше значения, расчет дает  $J_{sat} \sim 30 \,\mathrm{A/cm^2}$ . Отметим, что J<sub>sat</sub> пропорциональна квадрату концентрации носителей, которая в свою очередь экспоненциально зависит от ширины запрещенной зоны. Учитывая это, экспериментальная и расчетная величины находятся в хорошем согласии, из чего следует применимость эмпирического выражения (7). При этом аппроксимация экспериментальных данных также подразумевает проведение процедуры поиска участка пропорциональности на регистрируемой зависимости L-J и определения коэффициента пропорциональности р.

Таким образом, экспериментально и расчетно изучено явление насыщения интенсивности люминесценции при больших уровнях инжекции (при концентрациях 2*D*-носителей  $d \sim 10^{12} \,\mathrm{cm}^{-2}$ ). Предложен метод экспериментального определения плотности тока  $J_{sat}$ , при которой наблюдается насыщение интенсивности электролюминесценции для одной квантовой ямы. Полученное согласие расчетных данных с экспериментальными свидетельствует о применимости предложенного способа определения значения плотности тока, при котором начинается насыщение интенсивности электролюминесценции светодиодов с квантовыми ямами.

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] E.F. Schubert. *Light-emitting diodes* (Cambridge University Press, 2006).
- [2] А.В. Малевская, Н.А. Калюжный, Д.А. Малевский, С.А. Минтаиров, А.М. Надточий, М.В. Нахимович, Ф.Ю. Солдатенков, М.З. Шварц, В.М. Андреев. ФТП, 55 (8), 699 (2021). DOI: 10.21883/{FTP}.2021.08.51143.9665
- M. Hirotani, T.E. Sale, J. Woodhead, J.S. Roberts, P.N. Robson, T. Saka, T. Kato. J. of Crystal Growth, **170**, 390–393 (1997). DOI: 10.1016/S0022-0248(96)00534-9

- [4] N.E.J. Hunt, E.F. Schubert, D.L. Sivco, A.Y. Cho, G.J. Zydzik. Electron. Lett., 28 (23), 2169 (1992).
   DOI: 10.1049/el:19921392
- Y. Yu, X. Qin, B. Huang, J. Wei, H. Zhou, J. Pan, W. Chen, Y. Qi, X. Zhang, Z. Ren. Vacuum, 69 (4), 489–493 (2003). DOI: 10.1016/S0042-{207X}(02)00560-2
- [6] H. De Neve, J. Blondelle, P. Van Daele, R. Baets,
   P. Demeester, G. Borghs. Electron. Lett., 30 (21),1787-1789 (1994). DOI: 10.1049/el:19941216
- [7] T. Takamori, A.R. Pratt, T. Kamijoh. Appl. Phys. Lett., 74 (24), 3598–3600 (1999). DOI: 10.1063/1.123193
- [8] H.-J. Lee, G.-H. Park, J.-S. So, C.-H. Lee, J.-H. Kim, L.-K. Kwac. Infrared Phys. Technol., 118, 103879 (2021). DOI: 10.1016/j.infrared.2021.103879
- [9] D.-K. Kim, H.-J. Lee. J. Nanosci. Nanotechnol., 18 (3), 2014–2017 (2018). DOI: 10.1166/jnn.2018.14952
- [10] М.А. Минтаиров, В.В. Евстропов, С.А. Минтаиров, А.М. Надточий, Р.А. Салий, М.З. Шварц, Н.А. Калюжный. Письма в ЖТФ, 46 (12), 30 (2020). DOI: 10.21883/{PJTF}.2020.12.49524.18284
- [11] M.A. Mintairov, V.V. Evstropov, S.A. Mintairov, R.A. Salii,
   M. Z. Shvarts, N.A. Kalyuzhnyy. Semiconductors, 52 (10), 1244–1248 (2018). DOI: 10.1134/S1063782618100135
- M.A. Mintairov, V.V. Evstropov, M.Z. Shvarts, S.A. Mintairov, R.A. Salii, N.A. Kalyuzhnyy. AIP Conf. Proc., **1747**, 050003 (2016). DOI: 10.1063/1.4954366